

Если канал П. т.— полупроводник *p*-типа, то к истоку прикладывается положительный потенциал, а к стоку — отрицательный. При любом типе проводимости канала ток всегда переносится носителями заряда только одного знака: либо электронами, либо дырками, поэтому П. т. наз. иногда униполярными транзисторами.

Различают 2 вида типа П. т. К первому типу относят П. т., в которых затвором служит *p*—*n*-переход (П. т. с управляющим *p*—*n*-переходом) или барьер металла — полупроводник (*Шоттки барьер*). Ко второму типу относят П. т., в которых металлический электрод затвора отделён от канала тонким слоем диэлектрика, — П. т. с изолированным затвором.

Идея, лежащая в основе работы П. т. с затвором в виде *p*—*n*-перехода, высказана в нач. 50-х гг. У. Шокли (W. Shockley, США). Она поясняется на рис. 2. Под металлическим электродом затвора П. т. сформирован *p*-слой, так что между затвором и любым из двух др. электродов П. т. существует *p*—*n*-переход. Толщина канала *d*, по к-руму ток может протекать между истоком и стоком, зависит от напряжения, приложенного к затвору. Между истоком и затвором прикладывается напряжение U_3 , смещающее *p*—*n*-переход в запорном направлении (в П. т. с каналом *n*-типа это условие соответствует «минус» на затворе). Тогда под затвором возникает обеднённый слой (см. *p*—*n*-переход), имеющий очень высокое сопротивление. Чем больше напряжение U_3 , тем больше толщина обеднённого слоя. В пределах обеднённого слоя ток практически не может. Поэтому увеличение U_3 соответствует сужению канала, по к-руму протекает ток между истоком и стоком. Меняя напряжение на затворе, можно управлять током в канале. Чем больше U_3 , тем толще обеднённый слой и тоньше канал и, следовательно, тем больше его сопротивление и тем меньше ток в канале. При достаточно большой величине U_3 обеднённый слой под затвором может полностью перекрыть канал, и ток в канале обратится в нуль. Соответствующее напряжение $U_3 = U_0$ наз. напряжением отсечки.

Ширина области объёмного заряда обратносмешённого *p*—*n*-перехода

$$W = \left[\frac{2\epsilon_0(U_3 + U_k)}{eN_d} \right]^{1/2},$$

где e — заряд электрона, N_d — концентрация доноров в материале канала, ϵ — диэлектрическая проницаемость материала, $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — диэлектрическая постоянная, U_k — контактная разность потенциалов в *p*—*n*-переходе. Очевидно, толщина канала $d = h = W$, где h — геом. толщина канала (рис. 2). Напряжение отсечки U_0 находится из условия $W = h$:

$$U_0 = \frac{eN_d h^2}{2\epsilon_0} - U_k \approx \frac{eN_d h^2}{2\epsilon_0}.$$

Принцип работы П. т. с затвором в виде барьера Шоттки (ПТШ) аналогичен. Разница лишь в том, что обеднённый слой в канале под затвором создаётся приложением запорного напряжения к контакту металл — полупроводник.

ПТШ и П. т. с управляющим *p*—*n*-переходом, как правило, являются П. т. с нормально открытым каналом. Так принято наз. П. т., в которых при отсутствии напряжения на затворе ($U_3 = 0$) канал открыт и между истоком и стоком возможно протекание тока. В цифровых устройствах для снижения потребляемой мощности применяют также и нормально закрытые П. т. В этих приборах толщина канала h настолько мала, что канал под действием контактной разности потенциалов U_k при нулевом напряжении на затворе полностью обеднён носителями заряда, т. е. канал практически закрыт. Рабочей областью входных сигналов таких П. т. являются отпирающие значения U_3 от $U_3 = 0$ до $U_3 \approx U_k$.

В П. т. с изолированным затвором между каналом П. т. и металлическим электродом затвора размещается тонкий

слой диэлектрика (рис. 3, 4). Поэтому такие П. т. наз. МДП-транзисторами (металл — диэлектрик — полупроводник; см. МДП-структура). Часто в МДП-транзисторе слоем диэлектрика служит окисел на поверхности полупроводника. В этом случае П. т. наз. МОП-

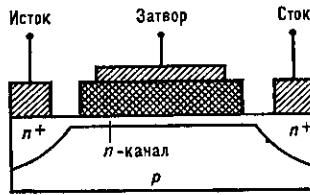


Рис. 3.

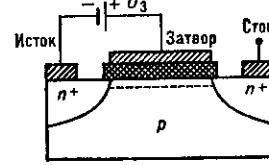


Рис. 4.

транзисторами (металл — окисел — полупроводник). Первые МДП-транзисторы появились в сер. 50-х гг.

МДП-транзисторы могут быть как с нормально открытым, так и с нормально закрытым каналами. МДП-транзистор с нормально открытым, встроенным каналом показан на рис. 3 на примере МДП-транзистора с каналом *n*-типа. Транзистор выполнен на подложке *p*-типа. Сверху подложка методами диффузии, ионной имплантации или эпитаксии формируются проводящий канал *n*-типа и две глубокие *p*⁺-области для создания омич. контактов в области истока и стока. Область затвора представляет собой конденсатор, в к-ром одной обкладкой служит металлический электрод затвора, а другой — канал П. т. Если между затвором и каналом приложить напряжение, то в зависимости от его знака канал будет обогащаться или обедняться подвижными носителями заряда. Соответственно, сопротивление канала будет уменьшаться или возрастать. В показанной на рис. 3 МДП-структуре с каналом *n*-типа напряжение, «плюс» к-рого приложено к затвору, а «минус» — к каналу (истоку или стоку), вызывает обогащение электронами приповерхностного слоя полупроводника под затвором. Обратная полярность напряжения на затворе вызывает обеднение канала электронами аналогично П. т. с управляющим *p*—*n*-переходом.

Для работы МДП-транзистора принципиально важно, чтобы поверхность раздела диэлектрик — полупроводник под затвором имела низкую плотность электронных поверхностных состояний. В противном случае изменение напряжения на затворе может приводить к изменению концентрации носителей в канале, а лишь к переизрядке поверхностных состояний.

МДП-транзистор с индуцированным каналом показан на рис. 4. Из сравнения рис. 3 и 4 видно, что этот транзистор отличается от МДП-транзистора со встроенным каналом отсутствием *n*-слоя под затвором. Если напряжение на затворе отсутствует ($U_3 = 0$), то в МДП-транзисторе, показанном на рис. 4, отсутствует и канал (транзистор с нормально закрытым каналом), а сам транзистор представляет собой два последовательно включённых *p*—*n*-перехода. При любой полярности напряжения между истоком и стоком один из этих *p*—*n*-переходов оказывается включённым в обратном направлении и ток в цепи исток — сток практически равен нулю.

Если приложить к затвору напряжение U_3 в такой полярности, как показано на рис. 4, то поле под затвором будет оттеснять дырки и притягивать в подзатворную область электроны. При достаточно большом напряжении U_3 , называемом напряжением отпирания, под затвором происходит инверсия типа проводимости: вблизи затвора образуется тонкий слой *n*-типа. Между истоком и стоком возникает проводящий канал. При дальнейшем увеличении U_3 возрастает концентрация электронов в канале и сопротивление его уменьшается.

Основные параметры П. т. Для П. т. характерно очень высокое входное сопротивление по пост. току $R_{\text{вх}}$.